

太陽光発電研究センター 第6回成果報告会 2010/8/9-10

薄膜シリコン太陽電池への化学機械研磨の適用と 光閉じ込め効果の解析

齋 均

(独) 産総研 太陽光発電研究センター シリコン新材料チーム

共同研究者

金森 義明 准教授(東北大学)

謝辞 松井 卓矢、鯉田 崇、賈 海軍、増田 淳(以上産総研)

本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けて実施されたものであり、関係各位に感謝致します。

研究背景

テクスチャ構造による光閉じ込め

- 光散乱による光路長増大
- 屈折率マッチングによる反射低減

通常は表裏両面にテクスチャが形成 Q. 表面、裏面の寄与はどの程度?

片面側のみにテクスチャを持つ 太陽電池の作製・評価 ↓ 表/裏面テクスチャの役割を<u>実デバイス上</u> で定量化し、光閉じ込め構造の更なる改善 に向けた指針を得る。



実験

太陽電池:表裏テクスチャ

太陽電池: *J*, η

EQE: p-i-n

EQE (*n-i-p*)

表/裏面テクスチャと赤外感度

TCO厚さによる光学挙動の変化

内部全反射の臨界角

- ・Si/air :16°(半球の4%)
- Si/TCO: 27 ~ 32° (11 ~ 15%)

TCOが波長に対してごく薄い場合:
●表面にテクスチャが無くても、内部 全反射により光が閉じ込められる。
●TCO層での光吸収が小さい。

吸収損失

まとめ

微結晶シリコン太陽電池(厚さ2µm)の光閉じ込めについて、実デバイス上で 表/裏面テクスチャの寄与の切り分けを試みた。

□ 光散乱に加え、表面TCO・<u>裏面BSR</u>の吸収損失抑制が重要